

MPI TS2500-SE | ShieldEnvironment™付き200 mm フルオート・プローブシステム

広い温度範囲で正確、高信頼性、24/7稼働の製造試験に対応

Software Suite SENTIO®

- マルチタッチ、シングルWindows® GUIによる、簡易で直観的なシステムオペレーション
- スクロール、ズーム、ムーブなどのスマートフォンと同様なコマンドを使って、誰でも短時間で簡単に操作可能
- アプリケーションの変更は指一つで
- MPI RF校正用ソフトウェア QAlibria® と統合することにより、使い勝手を格段に向上
- GPIB、TCP/IP経由によるリモート・コントロール

温度コントロール

- 温度チャックは完全に統合されたタッチスクリーン・ディスプレイから操作可能
- オペレータの前面に取付られており、迅速なオペレーション、フィードバックが可能

顕微鏡関連オプション

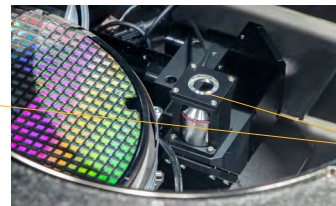
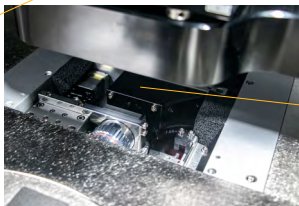
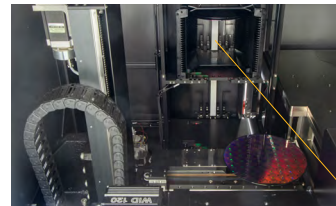
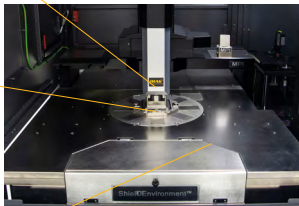
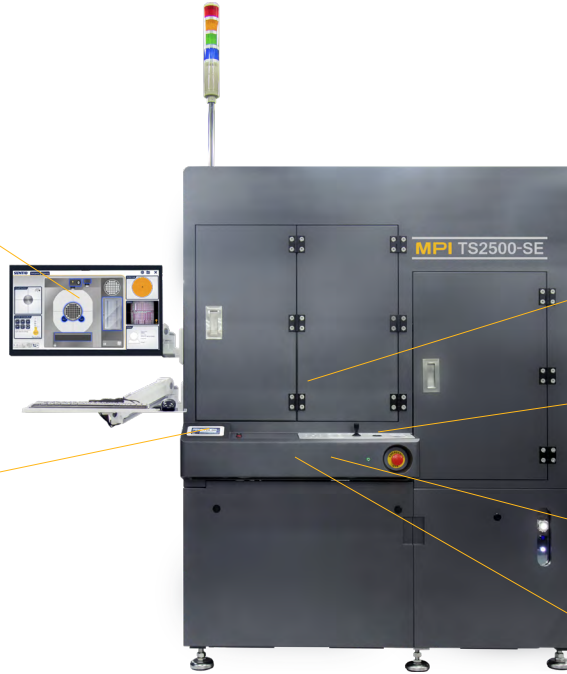
- 50 x 50 x 140 mm移動可能プログラマブル顕微鏡移動機構
- 種々の顕微鏡を用意。MPI AMZ12、12倍光学ズーム顕微鏡および MPI iMAG® デジタル顕微鏡

ShieldCap™

- シールディングかつ簡単な組み換えを実現
- 最大 4個のRF または8個のDC/ケルビン構成可能 (またはこれらの組み合わせ)
- プローブカード用も用意

マイクロポジショナ

- 最高 8個のDC、または 4個のRF および 4個のDC マイクロポジショナ
- 種々のマイクロポジショナを用意。プログラマブル型、ミリ波用ラージエリア型等
- 専用同軸、トライアキシャル、ケルビン・アームを用意
- 4.5" / 6.5"用プローブ・カードホルダを用意 (標準タイプ、長時間温度評価用の両方)



RF 校正

- オプションで2つの校正用補助チャックを追加可能
- 正確なRF校正のために補助チャックにセラミックを使用
- 一定の平坦度が保たれる様に1 μmの平坦度を確保

製造ラインで使える信頼性

- 24/7稼働の製造ライン使用に十分な信頼性
- インターロック付き安全カバーによるクローズド環境

統合されたハードウェア・コントロールパネル

- 迅速で安全なシステム・コントロールおよび測定操作が可能
- キーボードとマウスはソフトウェアのコントロールおよびWindows® ベース測定器のコントロールに使用

ShieldEnvironment™

- 最新EMI / RFI / 光シールドによる 安定な1/f 測定を実現
- fA レベルの超低リーク測定

AirCool® PRIME 温度チャック

- MPIおよびERSの共同設計により短い温度遷移時間とソーキング時間の短縮を実現
- 種々の選択が可能で広い温度範囲をカバー：-60 °C to 300 °C
- コントロールパネルを便利な場所に取り付け、スピーディー、簡単に操作可能
- チャラーを効率良く統合してシステムのフットプリントを縮小
- チャック用CDAの再使用によるパーキングにより、CDA使用量の削減

ウエハ・ローディング

- 100 または150 mmウエハ、または200 mmウエハ用の標準カセット、2個

その他のオプション

- 標準オフアキス・アライメント・カメラ
- PTPAのためのアップワード・ルッキング・カメラ